

**SEMINAR:****Plasma Prozess Technologie****Schwerpunkt:****Schädigungsarmes Ätzen und Beschichten**

am Donnerstag, den 28. März 2019

in Berlin-Adlershof

Veranstalter:**SENTECH Gesellschaft für Sensortechnik mbH**
Konrad-Zuse-Bogen 13, 82152 Krailling**Veranstaltungsort:****SENTECH Instruments GmbH**
Schwarzschildstr. 2, Berlin-Adlershof
Tel.: +49 30 6392 - 5520**Seminarprogramm**

- 09:00 **Begrüßung und Vorstellung des Programms**
SENTECH GmbH, Krailling
- 09:10 **Produktüberblick mit Anwendungsfeldern der SENTECH Plasma Prozess Technologie**
Frank Schmidt, SENTECH Instruments GmbH, Berlin
- 09:40 **Grundlagen zum schädigungsarmen Ätzen und Beschichten**
Marcel Schulze, SENTECH Instruments GmbH, Berlin
- 10:10 Kaffeepause und Diskussion**
- 10:30 **Schädigungsarme Abscheidung von Si-Nitrid**
Peter Brückner, Fraunhofer-Institut für Angewandte Festkörperphysik IAF, Freiburg
- 11:00 **Testbauelementherstellung zur Charakterisierung von Halbleitergrundmaterialien**
Johannes Heitmann, TU Bergakademie Freiberg, Instituts für Angewandte Physik, Freiberg
- 11:30 **Nanofabrikation von diffraktiven Röntgenlinsen für Synchrotronstrahlung und darüber hinaus**
Martin Bednarzik, Paul-Scherrer-Institut, LMN, Villigen-Würenlingen, Schweiz
- 12:00 Mittagessen und Diskussion**
- 13:00 **Herstellung supraleitender Kalorimeter mit höchster Energieauflösung für die Anwendung in der multispektralen Fluoreszenzmikroskopie**
Katja Peiselt, Leibniz-Institut für Photonische Technologien e.V. (IPHT), Jena
- 13:30 **Development of PEALD Oxide Processes for Optical Coatings on Complex Shaped Substrates**
Vivek Beladiya, Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF, Jena
Autoren: Vivek Beladiya, Kristin Pfeiffer, Lilit Ghazaryan, Pallabi Paul, Adriana Szeghalmi
- 14:00 **Ätzen und Beschichten von Wafern ohne Rückseitenberührung (edge grip)**
Mirko Siebert, SENTECH Instruments, Berlin
- 14:30 Kaffeepause und Diskussion**
- 14:45 **Cluster Lösungen zum Ätzen und Beschichten**
Friedrich P. Witek, SENTECH Instruments GmbH, Berlin
- 15:20 **Anlageneinbindung in das Produktionsumfeld mittels SECS/GEM**
Phillip Schwarzrock, SENTECH Instruments GmbH, Berlin
- 15:50 **Alle Teilnehmer des Seminars sind zum Besuch der Applikationslabore bei SENTECH Instruments eingeladen**
- 16:30 Ende des Seminars**